

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成23年7月21日(2011.7.21)

【公表番号】特表2010-531043(P2010-531043A)

【公表日】平成22年9月16日(2010.9.16)

【年通号数】公開・登録公報2010-037

【出願番号】特願2010-513314(P2010-513314)

【国際特許分類】

H 05 F 3/04 (2006.01)

H 01 T 23/00 (2006.01)

H 01 T 19/04 (2006.01)

H 05 F 3/06 (2006.01)

【F I】

H 05 F 3/04 E

H 01 T 23/00

H 01 T 19/04

H 05 F 3/06

【手続補正書】

【提出日】平成23年6月2日(2011.6.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(a) 第1側面に少なくとも近接して配置可能な接地した要素と、

(b) イオン源及び、第2側面に近接して配置可能な第2の接地した要素と、を含み、前記第2の接地した要素が前記イオン源と前記第2側面との間に配置される、表面を正味で中性化する装置。

【請求項2】

(a) 第1側面に少なくとも近接して接地した要素を提供することと、

(b) イオン源と、第2側面に近接して第2の接地した要素とを供給することと、を含み、前記第2の接地した要素が前記イオン源と前記第2側面との間に配置される、表面を中性化するための方法。

【請求項3】

(a) ウェブを供給するウェブ源と、

(b) 前記ウェブの上に作用するように配置されたコロナ処理装置と、

(c) 二極性中性化装置であって、

(i) 前記ウェブの第1面に対して配置された、接地したローラーと、

(ii) イオン源と、前記ウェブの第2面に近接して配置された、第2の接地した要素とを含み、前記第2の接地した要素が前記イオン源と前記第2面との間に配置される、二極性中性化装置と、

を含む、ウェブ処理装置。

【請求項4】

(a) ウェブを供給するウェブ源と、

(b) 二極性中性化装置であって、

(i) 前記ウェブの第1面に対して配置された、接地したローラーと、

( i i ) イオン源及び、前記ウェブの第2面に近接して配置された、第2の接地した要素を含み、前記第2の接地した要素が前記イオン源と前記第2面との間に配置される、二極性中性化装置と、

( c ) 前記二極性中性化装置のダウンウェブのコーティングステーションと、

( d ) 前記コーティングステーションのダウンウェブのギャップ乾燥器と、  
を含む、ウェブ処理装置。